

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Nur. 2007. *Analisis Sifat Listrik Persambungan M-S-M pada Film Tipis Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N yang Ditumbuhkan di Atas Substrat Silikon (111) dengan Metode DC Magnetron Sputtering*. Tersedia [Online] [http%3A%2F%2Fdigilib.unnes.ac.id](http://3A%2F%2Fdigilib.unnes.ac.id) [08 Desember 2010]
- Anonim. 2004. *Teknologi Semikonduktor Sekarang dan yang Akan Datang*. Tersedia [Online] <http://www.opto.lipi.go.id/utama.cgi> [4 November 2010]
- Anonim. 2009. *Difraksi*. Tersedia [Online] <http://id.wikipedia.org/wiki/Difraksi> [11 April 2010]
- Anonim. 2009. *Ohmic Contact*. Tersedia [Online] [http://en.wikipedia.org/wiki/Ohmic\\_contact](http://en.wikipedia.org/wiki/Ohmic_contact) [11 Februari 2011]
- Anonim. 2009. *Work Function*. Tersedia [Online] [http://en.wikipedia.org/wiki/Work Function](http://en.wikipedia.org/wiki/Work_Function) [11 Februari 2011]
- Anonim. 2009. *History Silicon*. Tersedia [Online] <http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon#History> [11 April 2010]
- Anonim. 2009. *Kekristalan Kubik/Padatan*. Tersedia. [Online] <http://lischer.wordpress.com/2009/09/03/kekristalan-kubikpadatan/> [11 April 2010]
- Anonim. 2010. *Schottky barrier*. Tersedia. [Online] [http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky barrier](http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_barrier) [25 Desember 2010]

- Ardiannis. 2008. *Difraksi Sinar X*. Tersedia. [Online]  
<http://ardiannisworld.blogspot.com/2008/01/difraksi-sinar-x.html> [11 April 2010]
- Feliciano, dkk. 2009. *X-Ray Diffractometer (XRD)*. Tersedia. [Online]  
<http://tk.uns.ac.id/file/Kuliah/Kimia%20Fisika/Tugas%20I/XRD%20II.pdf>  
 [17 Mei 2010]
- Foresi, J.S Moustanas T.D. 1944. *Metal Contact to GaN*. Appl.Phys. Let 62(22/2859).  
 [10 Februari 2011]
- Gil, Bernard. 1998. *Group III Nitride Semiconductor Compounds Physics and Application*. Oxford University Press, Inc. New York:
- Marlini, Nofi. 2009. *Mikrostruktur Lapisan Tipis Semikonduktor Galium Nitrida yang Ditumbuhkan Menggunakan Metode Chemical Solution Deposition Dengan Variasi Laju Spin Counting*. Tersedia. [Online]  
[http://eprints.undip.ac.id/2984/1/MIKROSTRUKTUR\\_LAPISAN\\_TIPIS\\_SEMIKONDUKTOR\\_GALIUM\\_NITRIDA\\_YANG\\_DITUMBUHKAN\\_MENGGUNAKAN\\_METODE\\_CHEMICAL\\_SOLUTION\\_DEPOSITION\\_DENGAN\\_VARIA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/2984/1/MIKROSTRUKTUR_LAPISAN_TIPIS_SEMIKONDUKTOR_GALIUM_NITRIDA_YANG_DITUMBUHKAN_MENGGUNAKAN_METODE_CHEMICAL_SOLUTION_DEPOSITION_DENGAN_VARIA.pdf) [11 April 2010]
- Maryanto. 2010. *Mikrostruktur Lapisan Tipis Semikonduktor  $Al_xGa_{1-x}N$  yang Ditumbuhkan pada Substrat Si(111) Menggunakan Metode Chemical Solution Deposition (CSD)*. Tersedia [Online]  
[eprints.undip.ac.id/19136/1/Maryanto\\_\\_J2D004182\\_.pdf](http://eprints.undip.ac.id/19136/1/Maryanto__J2D004182_.pdf) [20 November 2010]
- Mitzi, David B. 2009. *Solution Processing Of Inorganic Materials*. A John Wiley & sons, INC., Publication. Canada:

- Mursid, Ali. 2007. *Pengaruh Temperatur Deposisi Terhadap Karakteristik Film Tipis Galium Nitrida Yang Ditumbuhkan Diatas Substrat Spphire ( $Al_2O_3$ ) Dengan Metode Sol-Gel Menggunakan Teknik Spin-Coating*. Skripsi Sarjana Sains pada FPMIPA UPI Bandung: tidak diterbitkan
- Permana, Aria.2007. *Studi Awal Penumbuhan Film Tipis Galium Nitrida Dengan Metode Sol-Gel Menggunakan Teknik Spin-Coating*. Skripsi Sarjana Sains pada FPMIPA UPI Bandung: tidak diterbitkan
- Awaludin, Rahmat. 2010. *Karakterisasi Sifat Listrik Fotodiode Berbahan Dasar  $LiTaO_3$  yang Ditumbuhkan dengan Metode Spin-Coating*. Skripsi Sarjana Sains pada FPMIPA UPI Bandung: tidak diterbitkan
- Riyanto, dkk. 2007. *Analisis Struktur Kristal Menggunakan Difraksi Sinar-X*. Tersedia. [Online] <http://riyanto04.files.wordpress.com/2009/09/struktur-kristal.pdf> [15 Mei 2010]
- Sutanto, Heri. 2001. *Pengaruh Variasi Temperatur Penumbuhan Terhadap Karakteristik Sifat Listrik Film Tipis GaN di Atas Si(111) dengan Metode PA-MOCVD* [Online], Vol 4 (2), 5 halaman. Tersedia [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id) [29 Oktober 2010]
- Sutanto, dkk. 2005. *Karakteristik Struktur dan Listrik Film Tipis GaN yang Ditumbuhkan di atas Substrat Si(111) dengan Metode Plasma Assisted-Metalorganic Chemical Vapor Deposition (PA-MOCVD)* [Online], Vol 11 (1), 6 halaman Tersedia <http://www.fmipa.itb.ac.id> [14 November 2010]